



工业显微镜 LV150N/LV150NL/LV150NA/LV100ND/LV100DA-U

ECLIPSE LV-N



工业显微镜

**LV150N / LV150NL / LV150NA
LV100ND / LV100DA-U**



新的光学系统令 ECLIPSE 焕发新风采。

ECLIPSE 显微镜机身采用模块化制造，可满足多领域的工业应用，其中包括半导体器件、封装、FPD、电子器件、材料和精密模具制造等。

ECLIPSE LV 系列经过不断的发展完善并配备了新的光学系统和功能，可根据观察方法和目的选择支架装置和照明装置以满足多种观察需求。

用户可选择使用电动和手动操控模式以及反射照明专用模式和反射 / 透射组合照明模式以满足任何应用需求。

CFI60-2

经过改进的光学性能

以独特的高数值孔径和长工作距离设计理念而著称的尼康 CFI60 光学系统经过进一步改进，具有一流的长工作距离、色差校正性能和更轻的重量。

轻松的操作

与数码相机集成

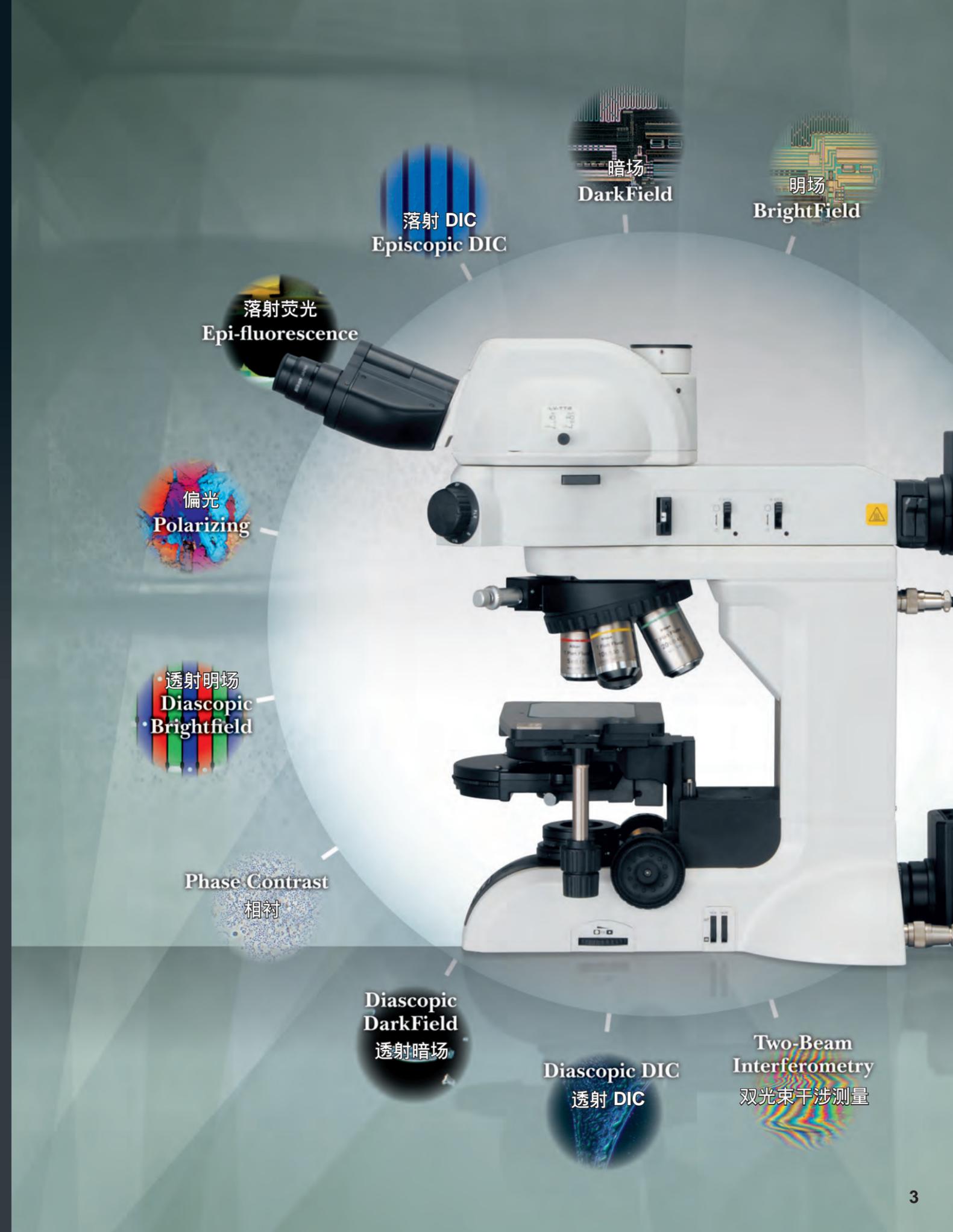
现可使用数码控制装置来检测包括物镜信息在内的显微镜信息，以及对显微镜进行电动操作，以更高效地进行观察和图像拍摄。

观察方法

多种观察方法

采用透射照明观察时，用户可借助各类附件采用多种方法观察更多种类的标本。

所有型号都具备明场、暗场、微分干涉、荧光、偏光和双光束干涉测量观察功能。此外，LV100DA 和 LV100DA-U 还可提供透射型微分干涉、暗场、偏光和相衬观察功能。



LV-N 系列

型号特点



显微镜类型

手动型

电动型
(物镜转换器)

手动型

电动型
(物镜转换器 / 光强 / 孔径光阑 / 观察方法选择器)

兼容的观察方法

		明场	暗场	DIC	荧光	偏光	相衬	双光束干涉测量
LV150/ LV150NA	落射	○	○	○	○	○	—	○
LV150NL		○	—	○	—	○	—	○

* 使用适合于观察方法的物镜。

		明场	暗场	DIC	荧光	偏光	相衬	双光束干涉测量
LV100ND/ LV100DA-U	落射	○	○	○	○	○	—	○
	透射	○	○	○	—	○	○	—

* 使用适合于观察方法的物镜。

兼容的载物台

- LV-S32 3x2 载物台 (行程: 75 x 50 mm, 带玻璃板)
* 可配合使用 LV-S32SPL ESD 板
- LV-S6 6x6 载物台 (行程: 150 x 150 mm)
* 可配合使用 LV-S6WH 晶片夹 / LV-S6PL ESD 板
- LV-SRP P 旋转式载物台
- P-GS2 G 载物台 2 (配合载物台适配器 LV-SAD 使用)

- LV-S32 3x2 载物台 (行程: 75 x 50 mm, 带玻璃板)
* 可配合使用 LV-S32SGH 载玻片标本夹。
- LV-S64 6x4 载物台 (行程: 150 x 100 mm, 带玻璃板)
- LV-SRP P 旋转式载物台
- P-GS2 G 载物台 2 (配合载物台适配器 LV-SAD 使用)
- NIU-CSRR2 Ni-U 右手柄旋转型陶瓷载物台 (行程: 78 x 54 mm)
- C-SR2S 右手柄载物台 (行程: 78 x 54 mm: 配合载物台适配器 LV-SAD 使用)

与 Digital Sight
显微镜数码相机
集成

DS-L3 (独立型控制装置)

- 物镜信息检测
(与智能物镜转换器 LV-NU5I 和 LV-INAD 配合使用时)

- 物镜信息检测
和控制



DS-L3 (独立型控制装置)

- 物镜信息检测
(与智能物镜转换器 LV-NU5I 和 LV-INAD 配合使用时)

- 物镜、光强、孔径光阑和观察
方法 (明场 / 暗场 / 荧光) 信
息检测



DS-U3 + NIS-Elements (基于个人计算机控制的控制装置 + 成像软件)

- 物镜信息检测
(与智能物镜转换器 LV-NU5I 和 LV-INAD 配合使用时)

- 物镜信息检测
和控制



DS-U3 + NIS-Elements (基于个人计算机控制的控制装置 + 成像软件)

- 物镜信息检测
(与智能物镜转换器 LV-NU5I 和 LV-INAD 配合使用时)

- 物镜、光强、孔径光阑
和观察方法 (明场 / 暗
场 / 荧光) 信息检测和
控制



CFI60-2

经过改进的光学性能

以独特的高数值孔径和长工作距离设计理念而著称的尼康 CFI60 光学系统经过进一步改进，具有一流的长工作距离、色差校正性能和更轻的重量。

T Plan & TU Plan Fluor & TU Plan Apo 镜头

标准物镜 TU 平场荧光系列

EPI/BD 5x/10x/20x/50x/100x

这些通用型标准物镜只需一个镜头就能胜任明场、暗场、简易偏光、灵敏色偏光、微干涉和落射荧光观察等。新型半复消色差镜头具有卓越的色差校正性能并可在所有倍率下提供较长的工作距离，因而可胜任所有应用。



* 图片为明场观察 (EPI) 物镜。

型号	倍率	数值孔径	工作距离 (mm)
TU Plan Fluor EPI (明场型)	5x	0.15	23.5
	10x	0.30	17.5
	20x	0.45	4.5
	50x	0.80	1.0
	100x	0.90	1.0
TU Plan Fluor BD (明场/暗场型)	5x	0.15	18.0
	10x	0.30	15.0
	* 20x	0.45	4.5
	* 50x	0.80	1.0
	* 100x	0.90	1.0

* 使用复眼镜头。

低倍率物镜 T Plan EPI

EPI 1x/2.5x

这些低倍率物镜可使用传统型检偏器/起偏器进行清晰的观察操作，还可在不使用检偏器/起偏器的情况下进行简易的观察操作。



型号	倍率	数值孔径	工作距离 (mm)
T Plan EPI (明场型)	1x	0.03	3.8
	2.5x	0.075	6.5

复消色差物镜 TU Plan Apo 系列

EPI/BD 50x/100x/150x

采用菲涅耳相位镜头，这些物镜可在保留复消色差镜头的卓越色差校正性能的同时大幅提高工作距离。该系列新配备了 50x 镜头。



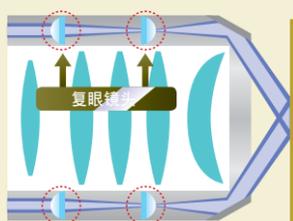
* 图片为明场观察 (EPI) 物镜。

型号	倍率	数值孔径	工作距离 (mm)
TU Plan Apo EPI (明场型)	50x	0.8	2.0
	100x	0.9	2.0
	150x	0.9	1.5
TU Plan Apo BD (明场/暗场型)	50x	0.8	2.0
	100x	0.9	2.0
	150x	0.9	1.5

暗场照明

复眼镜头

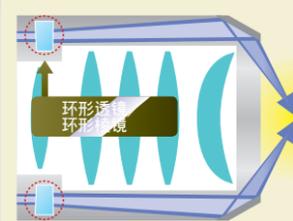
由于低倍率镜头通常具有较宽的实际视场，因而难以实现均匀、明亮的照明。但 CFI60-2 光学系统采用复眼镜头，可在整个视场中实现通透明亮的暗场照明。



复眼镜头可调节光线扩散角度，因而可使光线均匀直射到焦面上。

新型暗场照明系统

因数值孔径和工作距离的增加，物镜的外径也随之增加。但由于入射光的宽度是固定的，因而在使用传统照明系统时，光强会降低。该新型照明系统采用环形透镜或环形棱镜，可提高捕获的光量，提供高质量的暗场照明。



环形透镜/棱镜可捕获更多的光量以提高亮度。

TU Plan ELWD & T Plan SLWD 镜头

长工作距离 / 超长工作距离物镜

长工作距离物镜 TU Plan ELWD 系列

EPI/BD 20x/50x/100x

因使用菲涅耳相位镜头，这些物镜不仅可实现较长的工作距离，还可提供优于传统物镜的色差校正性能，进一步提高了针对不同等级标本的操作便利性。



* 图片为明场观察 (EPI) 物镜。

型号	倍率	数值孔径	工作距离 (mm)
TU Plan ELWD (明场型)	20x	0.4	19.0
	50x	0.6	11.0
	100x	0.8	4.5
TU Plan BD ELWD (明场/暗场型)	* 20x	0.4	19.0
	* 50x	0.6	11.0
	* 100x	0.8	4.5

* 使用新型暗场照明系统。

超长工作距离物镜 T Plan EPI SLWD

EPI 10x/20x/50x/100x

色差校正性能和工作距离均得到进一步提升的 T Plan SLWD 系列超长工作距离半复消色差物镜具有同级最佳的超长工作距离。使用该系列新配备的 SLWD 10x (WD: 37mm) 镜头可以观察更多种类的标本。



* 计划于 2013 年 1 月上市。

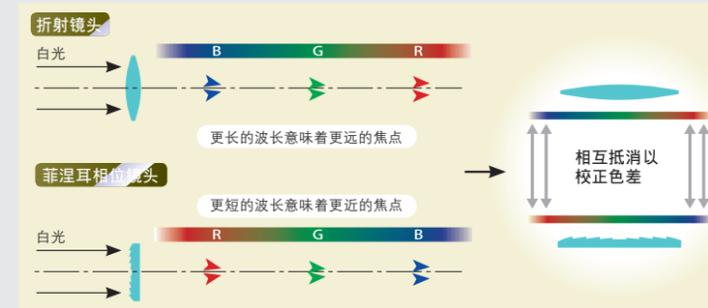
型号	倍率	数值孔径	工作距离 (mm)
T Plan EPI SLWD (明场型)	10x	0.2	37.0
	20x	0.3	30.0
	50x	0.4	22.0
	100x	0.6	10.0

菲涅耳相位

使用菲涅耳相位镜头提高色差校正性能和工作距离

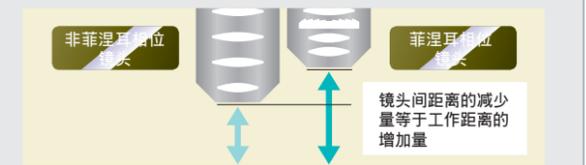
色差校正

传统镜头依赖于光线折射成像。由于各色光线 (波长) 的折射强度不同，图像会以蓝色、绿色和红色的顺序 (从离镜头最近的光线开始) 形成。相比之下，菲涅耳相位镜头则利用光线衍射按照红色、绿色和蓝色的顺序 (从离镜头最近的光线开始) 成像，因而成像属性与折射相反。结合使用这两种镜头可抵消各色光线的色差，从而可生成无色差的图像。



实现较长的工作距离

使用菲涅耳相位镜头，即便镜头之间的距离较短也能进行色差校正，因而可实现高于传统镜头的工作距离。



其他物镜

具有玻璃厚度校正功能的物镜

CFI L Plan EPI CR 20x/50x/100x

这些物镜配有不受玻璃基板厚度影响，高对比度观察细胞或图案的校正功能。



型号	倍率	数值孔径	工作距离 (mm)
CFI L Plan EPI CR (明场型)	20x CR	0.45	10.90 - 10.00
	50x CR	0.70	3.90 - 3.00
	100x CRA	0.85	1.20 - 0.85
	100x CRB	0.85	1.30 - 0.95

干涉测量物镜 / 双光束干涉测量物镜

CF IC EPI Plan TI/DI DI 10x/20x/50x/100x TI 2.5x/5x

这些 Michelson (TI) 和 Mirau (DI) 双光束干涉测量镜头可在不接触标本的情况下检测和测量细微差别。



型号	倍率	数值孔径	工作距离 (mm)
CF IC EPI Plan TI (用于干涉测量)	2.5xA	0.075	10.30
	5xA	0.130	9.30
CF IC EPI Plan DI (用于双光束干涉测量)	10xA	0.30	7.40
	20xA	0.40	4.70
	50xA	0.55	3.40
	100x	0.70	2.00

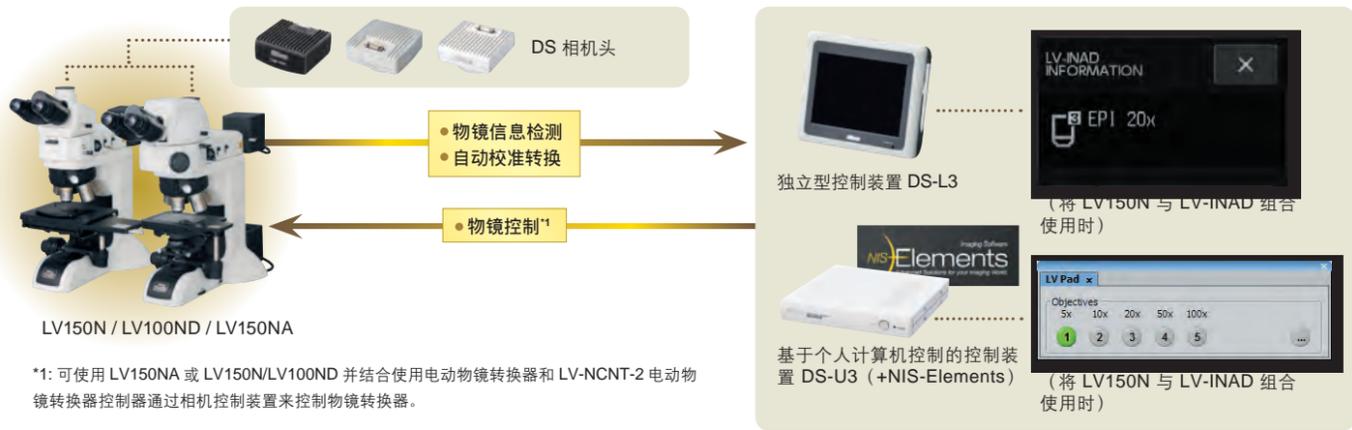
轻松的操作

与数码相机集成

LV150N/LV100ND/LV150NA 物镜信息检测和控制

加装智能物镜转换器 LV-NU5I 和新开发的倍率检测物镜转换器适配器 LV-INAD后, LV150N/LV100ND 显微镜可通过相机控制装置检测当前所用物镜的信息。在改变倍率时, 这些信息可自动转换为适用的校准数据。

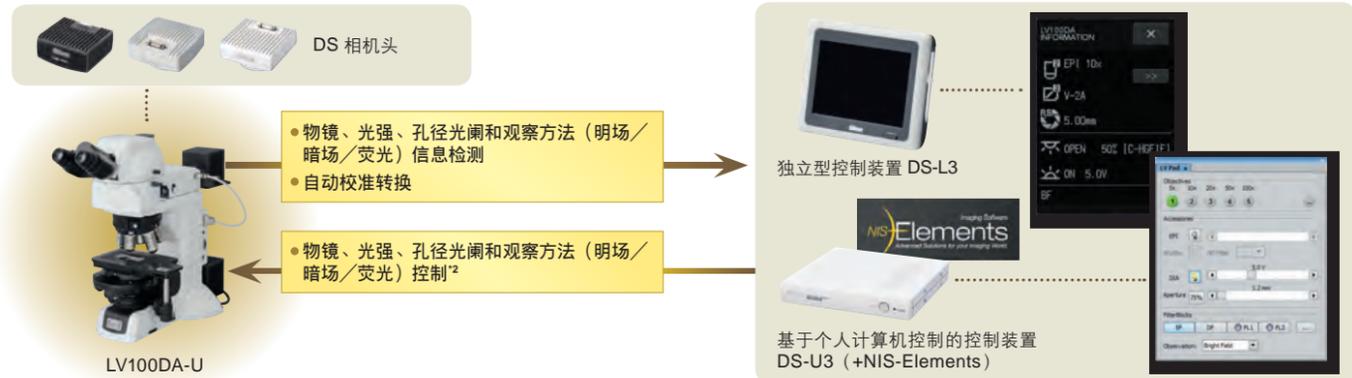
除可检测物镜信息外, LV150NA 还可通过相机控制装置转换物镜。



*1: 可使用 LV150NA 或 LV150N/LV100ND 并结合使用电动物镜转换器和 LV-NCNT-2 电动物镜转换器控制器通过相机控制装置来控制物镜转换器。

LV100DA-U 显微镜信息检测和控制

LV100DA-U 的用户可通过相机控制装置检测信息并对物镜、光强、孔径光阑和观察方法（明场/暗场/荧光）进行控制², 以便优化对图像采集至关重要的观察条件。



*2: 当连接了控制装置 DS-L3 时, 仅可进行信息检测。当连接了控制装置 DS-U3 (+NIS-Elements) 时, 可以控制物镜、光强、孔径光阑和观察方法（明场/暗场/荧光）。

	LV150N/LV100ND (使用 LV-NU5I 和 LV-INAD 时)		LV150NA		LV100DA-U (使用 LV-UEP12A 照明器时)	
	DS-L3	DS-U3 (+NIS-Elements)	DS-L3	DS-U3 (+NIS-Elements)	DS-L3	DS-U3 (+NIS-Elements)
物镜镜头	○	○	◎	◎	○	◎
反射照明 (ON/OFF, 光强调节)	—	—	—	—	○	◎
透射照明 (ON/OFF, 光强调节)	—	—	—	—	○	◎
孔径光阑	—	—	—	—	○	◎
观察方法选择器 (明场/暗场/荧光)	—	—	—	—	○	◎

* NIS-Elements F (免费软件包) 不兼容信息检测和控制功能。请使用 NIS-Elements D/Br/Ar。

控制装置

用于显微观察 “Digital Sight System” 的数码相机系统



独立型控制装置 DS-L3

DS-L3 配备了大尺寸触摸屏和多功能组件, 即便在无个人计算机或计算机监视器的情况下也可轻松、快速地采集图像。

高清晰触摸屏

DS-L3 内置 8.4" 1024 × 768 触摸屏。这款方便查看、易于操作的触摸屏可让用户通过手指或触控笔操作来轻松设置和操作相机头。

场景模式

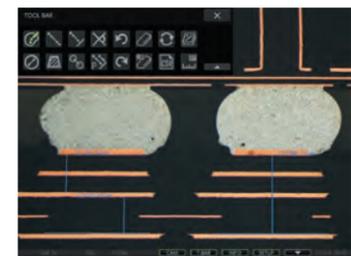
可使用图标针对各种标本类型和观察方法轻松设定最佳的成像参数。

- 晶片 / IC
- 金属、陶瓷 / 塑料
- 电路板
- 平板显示器



各种工具

DS-L3 可以执行简单的图像测量并输入线条和注释。DS-L3 可将这些数据添加至图像上并与图像一起保存。此外, 它还可输出测量数据。



测量功能

- 点到线的距离
- 点到线的距离
- 圆心之间的距离
- 角度
- 圆 (直径、半径)
- 面积
- 间距距离

位置和尺寸比较功能

- 刻度
- 十字线
- 格状
- XY 刻度
- XY 测量

绘图功能

- 计数标注
- 文本输入
- 高亮 (直线/曲线)

基于个人计算机的控制装置 DS-U3

从动态图像的显示和拍摄到高级图像处理和分析, DS-U3 的用户可通过个人计算机来控制所有功能, 这种灵活性非常适合范围较广的应用。

适合范围较广的应用

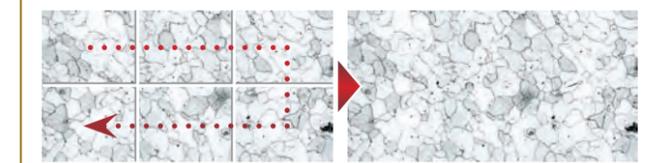
可使用 NIS-Elements 成像软件来执行图像采集、处理和分析。

NIS-Elements 综合成像软件系列

作为控制软件, NIS-Elements 系列具有从基本成像到显微镜和外围设备控制等多种辅助功能, 还可对采集的图像进行测量、分析和处理。

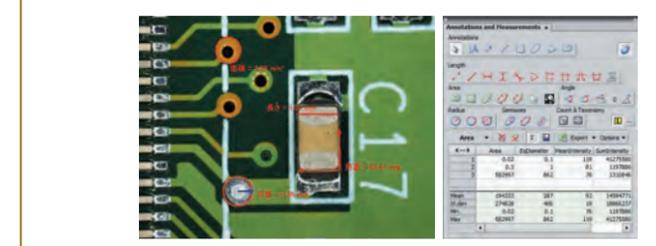
大图像

拍摄时可将多个视场拍摄的图像合成在一起, 创建视场较宽的图像。还可将已拍摄的图像合成在一起。



手动测量和图像标注

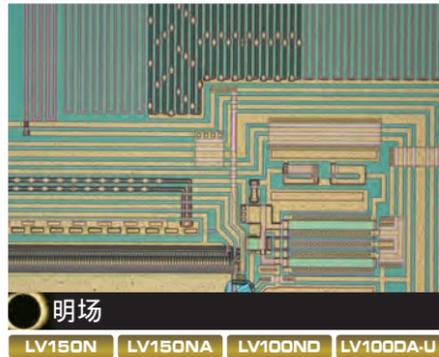
用户可通过手动测量功能在图像上直接绘制线条或图形以轻松测量长度和面积。测量结果可附加至图像或导出至记事本或 Excel 电子表格中。



* 有关 Digital Sight 特点的详细信息, 请参见 “显微镜用 Digital Sight 系列数码相机” 产品目录。

观察方法

可支持多种观察方法：明场、暗场、偏光、微分干涉、落射荧光和双光束干涉测量等。

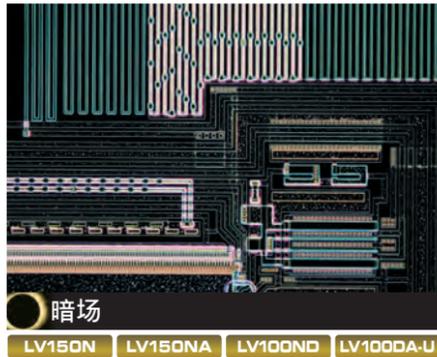


明场

LV150N LV150NA LV100ND LV100DA-U

半导体 (IC 晶片)

从物镜到照明系统, LV-N 系列采取了全方位的防眩光措施, 确保生成明亮、高对比度的图像。

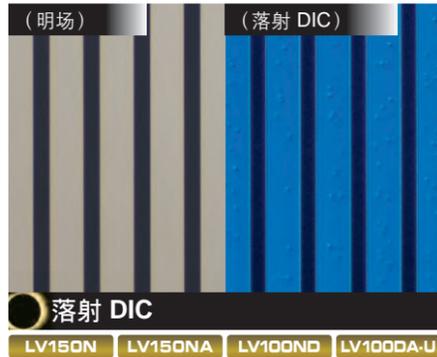


暗场

LV150N LV150NA LV100ND LV100DA-U

半导体 (IC 晶片)

采用尼康独特设计理念开发的物镜暗场照明系统可实现明亮的暗场观察, 从而可对标本差异和缺陷进行高灵敏度的检测。

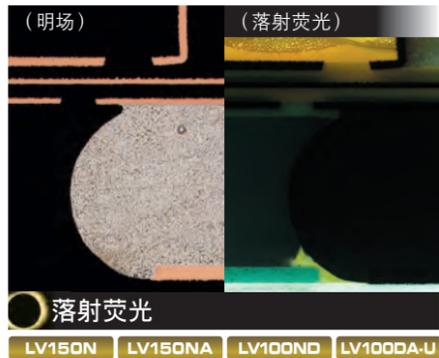


落射 DIC

LV150N LV150NA LV100ND LV100DA-U

基板

可使用适合标本观察的标准型和高对比度型 DIC 插片。LV-N 系列十分适合观察设备和精密模具中的细微差异等应用。

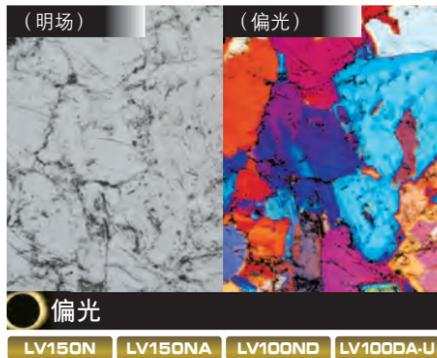


落射荧光

LV150N LV150NA LV100ND LV100DA-U

基板 (焊点)

LV-N 系列在观察有机 EL 或安装的基板等具有荧光性质的标本时表现出了卓越的性能。

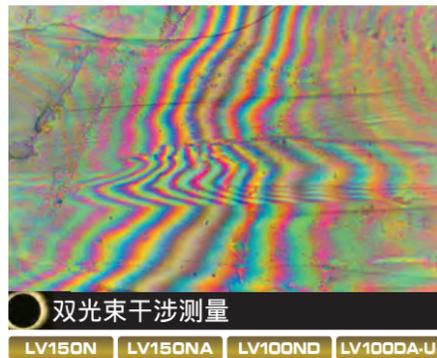


偏光

LV150N LV150NA LV100ND LV100DA-U

矿物质

LV-N 系列十分适合观察具有双折射性质的标本, 例如: 容易失真的液晶或塑料/玻璃等。



双光束干涉测量

LV150N LV150NA LV100ND LV100DA-U

云母

LV-N 系列可使用 Michelson (TI) 和 Mirau (DI) 反射型双光束干涉测量法。当配合使用测微计目镜时, 可在不接触标本的情况下检测和测量标本的细微差异。

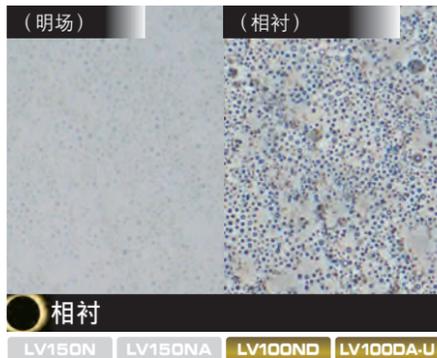


透射明场

LV150N LV150NA LV100ND LV100DA-U

LCD (彩色滤光片)

LV-N 系列十分适合观察透明标本, 例如: 光学器件、FPD 和载玻片标本。当配合使用 C-SP 简易起偏器和检偏器时, 可进行透射型简易偏光观察。



相衬

LV150N LV150NA LV100ND LV100DA-U

感光乳剂

可通过明/暗对比和利用衍射和干涉两种光线属性来显现无色、透明的标本。



透射 DIC

LV150N LV150NA LV100ND LV100DA-U

纳米粒子 (银)

可利用偏光使两束光之间产生干涉以在三维空间中观察无色、透明的标本。

规格

	LV150N	LV150NA	LV150NL
底座装置	最大标本高度: 38 mm (配合使用 LVNU5AI U5AI 物镜转换器和 LV-S32 3x2 载物台 / LV-S64 6x4 载物台时) * 配合使用柱增高块时为 73 mm 调光器用 12V50W 内部电源、粗和微调节手轮 左: 粗和微调节 / 右: 微调节, 40mm 行程 粗调节: 14 mm / 圈 (扭矩调节, 再定焦机构) 微调节: 0.1 mm / 圈 (以 1 μm 为单位进行调节) 载物台安装孔间隔: 70 x 94 (由 4-M4 螺丝固定)	LV-NU5A 电动通用五孔物镜转换器 ESD LV-NU5AC 电动通用五孔物镜转换器 ESD	最大标本高度: 38 mm (配合使用 LV-S32 3x2 载物台时) * 配合使用柱增高块时为 73 mm 内部 LED 照明电源、粗和微调节手轮 左: 粗和微调节 / 右: 微调节, 40mm 行程 粗调节: 14 mm / 圈 (扭矩调节, 再定焦机构) 微调节: 0.1 mm / 圈 (以 1 μm 为单位进行调节) 载物台安装孔间隔: 70 x 94 (由 4-M4 螺丝固定)
物镜转换器	C-N6 ESD 六孔物镜转换器 ESD LV-NU5 通用五孔物镜转换器 ESD LV-NBD5 BD 五孔物镜转换器 ESD LV-NU5I 智能通用五孔物镜转换器 ESD		C-N6 ESD 六孔物镜转换器 ESD LV-NU5 通用五孔物镜转换器 ESD
落射照明器	LV-UEPI-N LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱 明场 / 暗场切换和关联的孔径光阑 (可对中)、视场光阑 (可对中) 兼容 ø 25 mm 滤光片 (NCB11、ND16、ND4)、起偏器 / 检偏器、波长片、激发光平衡器; 配备噪声消除器 LV-UEPI2 LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱 HG 预对中光纤照明器: C-HGFIE (光线调节)*选购 明场 / 暗场切换和关联的孔径光阑 (可对中)、视场光阑 (可对中), 符合明场、暗场、落射荧光切换的自动光学器件切换功能 兼容 ø 25 mm 滤光片 (NCB11、ND16、ND4)、起偏器 / 检偏器、波长片、激发光平衡器; 配备噪声消除器		1.1W 白光 LED 兼容起偏器 / 检偏器
目镜筒	LV-TI3 三目镜目镜筒 ESD (正像, FOV: 22/25) LV-TT2 TT2 倾斜式三目镜目镜筒 (正像, FOV: 22/25) C-TB 双目镜筒 (倒像, FOV: 22) P-TB 双目镜筒 (倒像, FOV: 22) P-TT2 三目镜筒 (倒像, FOV: 22)		LV-TI3 三目镜目镜筒 ESD (正像, FOV: 22/25) C-TB 双目镜筒 (倒像, FOV: 22) P-TB 双目镜筒 (倒像, FOV: 22) P-TT2 三目镜筒 (倒像, FOV: 22)
载物台	LV-S32 3x2 载物台 (行程: 75 x 50 mm, 带玻璃板) ESD 兼容 LV-S64 6x4 载物台 (行程: 150 x 100 mm, 带玻璃板) ESD 兼容 LV-S6 6x6 载物台 (行程: 150 x 150 mm) ESD 兼容		LV-S32 3x2 载物台 (行程: 75 x 50 mm, 带玻璃板) ESD 兼容 LV-S6 6x6 载物台 (行程: 150 x 150 mm) ESD 兼容
目镜	CFI 目镜系列		
物镜镜头	工业显微镜 CFI ₁₀₀ -2/CFI ₁₀₀ 光学系统物镜系列: 根据观察方法组合使用		
ESD 性能	1,000 至 10V, 0.2 秒内 (不包括某些附件)		
能耗	1.2 A / 90 W		0.1A / 3W
重量	约 8.6 kg	约 8.7 kg	约 8.6 kg

	LV100ND	LV100DA-U
底座装置	最大标本高度: 38 mm (配合使用 LVNU5AI U5AI 物镜转换器和 LV-S32 3x2 载物台 / LV-S64 6x4 载物台时) 调光器用 12V50W 内部电源、粗和微调节手轮 左: 粗和微调节 / 右: 微调节, 40mm 行程 粗调节: 14 mm / 圈 (扭矩调节, 再定焦机构) 微调节: 0.1 mm / 圈 (以 1 μm 为单位进行调节)	最大标本高度: 33 mm (配合使用 LVNU5AI U5AI 物镜转换器和 LV-S32 3x2 载物台 / LV-S64 6x4 载物台时) 调光器用 12V50W 内部电源、粗和微调节手轮 左: 粗和微调节 / 右: 微调节, 40mm 行程 粗调节: 14 mm / 圈 (扭矩调节, 再定焦机构) 微调节: 0.1 mm / 圈 (以 1 μm 为单位进行调节)
物镜转换器	C-N6 ESD 六孔物镜转换器 ESD、LV-NU5 通用五孔物镜转换器 ESD LV-NBD5 BD 五孔物镜转换器 ESD、LV-NU5I 智能通用五孔物镜转换器 ESD D-ND6 六孔 DIC 物镜转换器	LV-NU5AI 电动通用五孔物镜转换器 (高耐用的电动5孔通用物镜转换器)
落射照明器	LV-UEPI-N LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱 明场 / 暗场切换和关联的孔径光阑 (可对中)、视场光阑 (可对中), 兼容 ø 25 mm 滤光片 (NCB11、ND16、ND4)、起偏器 / 检偏器; 配备噪声消除器 LV-UEPI2 LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱 HG 预对中光纤照明器: C-HGFIE (光线调节)*选购 明场 / 暗场切换和关联的孔径光阑 (可对中)、视场光阑 (可对中), 符合明场、暗场、落射荧光切换的自动光学器件切换功能 兼容 ø 25 mm 滤光片 (NCB11、ND16、ND4)、起偏器 / 检偏器、波长片、激发光平衡器; 配备噪声消除器	LV-UEPI2A LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱 HG 预对中光纤照明器: C-HGFIE (光线调节: 个人计算机控制)*选购 照明选择器转盘电动操作和控制 与明场 / 暗场选择器相关联的电动孔径光阑 (根据物镜自动优化)、视场光阑 (可对中) 兼容 ø 25 mm 滤光片 (NCB11、ND16、ND4)、起偏器 / 检偏器、波长片、激发光平衡器; 配备噪声消除器
透射照明器	LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱 (复眼光学系统) 内部孔径、视场光阑、滤光片 (ND8、NCB11); 透射 / 反射选择器切换; 还可使用 12V100W (选购)	
目镜筒	LV-TI3 三目镜目镜筒 ESD (正像, FOV: 22/25)、LV-TT2 TT2 倾斜式三目镜目镜筒 (正像, FOV: 22/25)、P-TB 双目镜筒 (倒像, FOV: 22)、P-TT2 三目镜筒 (倒像, FOV: 22)	
载物台	LV-S32 3x2 载物台 (行程: 75 x 50 mm, 带玻璃板) / LV-S32SGH 载玻片标本夹 LV-S64 6x4 载物台 (行程: 150 x 100 mm, 带玻璃板)、LV-SRP P 旋转式载物台 / P-GS2 旋转式载物台: 配合使用载物台适配器 LV-SAD NIU-CSRR2 Ni-U 右手柄旋转型陶瓷载物台 (行程: 78 x 54 mm)、C-SR2S 右手柄载物台 (行程: 78 x 54 mm: 配合使用载物台适配器 LV-SAD)	
聚光镜	LWD 消色差聚光镜 (明场)、LV-CUD U 干型聚光镜 (相衬、透射 DIC、暗场)、消色差 2x-100x 载玻片聚光镜 (明场)、DF 干型聚光镜 (暗场) 和其他	
目镜	CFI 目镜系列	
物镜镜头	工业显微镜 CFI ₁₀₀ -2/CFI ₁₀₀ 光学系统物镜系列: 根据观察方法组合使用	
ESD 性能	1,000 至 10V, 0.2 秒内 (不包括某些附件)	
能耗	1.2 A / 75 W	1.2 A / 90 W
重量	约 9.5 kg	约 10 kg

镜头规格

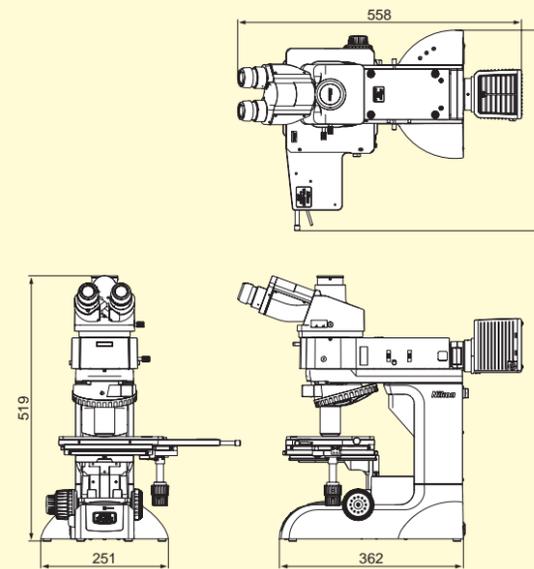
类型	型号	倍率	产品编号	数值孔径	工作距离 (mm)	
明场	T Plan EPI 平场 (半复消色差)	1x	MUE12010	0.03	3.8	
		2.5x	MUE12030	0.075	6.5	
	TU Plan Fluor EPI 通用平场荧光 (半复消色差)	5x	MUE12050	0.15	23.5	
		10x	MUE12100	0.3	17.5	
		20x	MUE12200	0.45	4.5	
		50x	MUE12500	0.8	1.0	
	TU Plan Apo EPI 通用平场复消色差  * 计划于 2013 年 1 月上市。	100x	MUE12900	0.9	1.0	
		50x	MUC11500	0.8	2.0	
		100x	MUC11900	0.9	2.0	
	偏光	TU Plan Apo EPI 通用平场复消色差  * 计划于 2013 年 1 月上市。	150x	MUC11150	0.9	1.5
TU Plan Fluor EPI P 偏光通用平场荧光 (半复消色差)			5x	MUE13050	0.15	23.5
			10x	MUE13100	0.3	17.5
			20x	MUE13200	0.45	4.5
			50x	MUE13500	0.8	1.0
明场长工作距离	TU Plan Apo EPI P 偏光通用平场荧光 (半复消色差)	100x	MUE13900	0.9	1.0	
		TU Plan EPI ELWD 长工作距离通用平场 (半复消色差) 	20x	MUE21200	0.4	19.0
			50x	MUE21500	0.6	11.0
			100x	MUE21900	0.8	4.5
明场超长工作距离	T Plan EPI SLWD 超长工作距离平场 (半复消色差)  * 计划于 2013 年 1 月上市。	10x	MUE31100	0.2	37.0	
		20x	MUE31200	0.3	30.0	
		50x	MUE31500	0.4	22.0	
		100x	MUE31900	0.6	10.0	
明场 / 暗场	TU Plan Fluor BD 通用平场荧光 (半复消色差)	5x	MUE42050	0.15	18.0	
		10x	MUE42100	0.3	15.0	
		20x	MUE42200	0.45	4.5	
		50x	MUE42500	0.8	1.0	
		100x	MUE42900	0.9	1.0	
	TU Plan Apo BD 通用平场复消色差  * 计划于 2013 年 1 月上市。	50x	MUC41500	0.8	2.0	
		100x	MUC41900	0.9	2.0	
明场 / 暗场长工作距离	TU Plan Apo BD 通用平场复消色差  * 计划于 2013 年 1 月上市。	150x	MUC41150	0.9	1.5	
		TU Plan BD ELWD 长工作距离通用平场 (半复消色差) 	20x	MUE61200	0.4	19.0
			50x	MUE61500	0.6	11.0
100x	MUE61900	0.8	4.5			

•  菲涅耳相位镜头 (衍射光学器件) • A 型圆形偏光板和消偏器内置于 T Plan EPI 1x/2.5x 中。(可安装 / 拆卸圆形偏光板。)

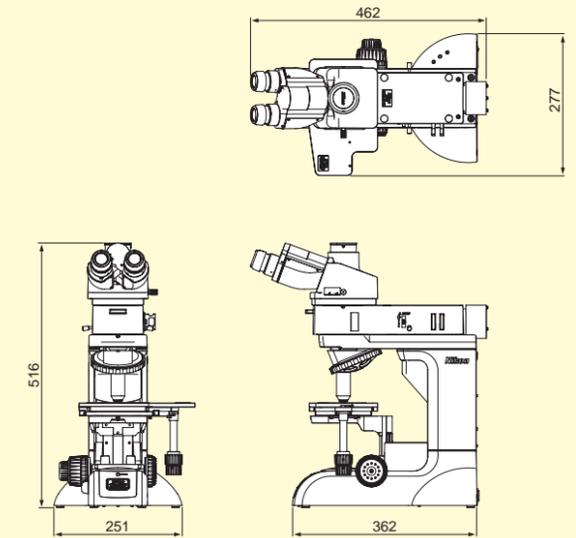
类型	型号	倍率	产品编号	数值孔径	工作距离 (mm)	
带校正机构的明场	L Plan EPI CR 用于检测 LCDs 平场	20x	MUE35200	0.45	10.9 - 10.0	
		50x	MUE35500	0.7	3.9 - 3.0	
		100x	MUE35900	0.85	1.2 - 0.85	
		100x	MUE35910	0.85	1.3 - 0.95	
明场	L Plan EPI Plan (消色差)	40x	MUE00400	0.65	1.0	
明场超长工作距离	LU Plan EPI SLWD 超长工作距离平场 (消色差)	20x	MUE30201	0.35	24.0	
		50x	MUE30501	0.45	17.0	
		100x	MUE30901	0.7	6.5	
明场	LU Plan Apo EPI 通用平场复消色差	100x	MUC00090	0.95	0.4	
		150x	MUC10151	0.95	0.3	
明场 / 暗场	LU Plan Apo BD 通用平场复消色差	100x	MUC40900	0.9	0.51	
		150x	MUC50151	0.9	0.42	
干涉测量	CF IC EPI Plan TI 用于干涉测量平场	2.5x	MUL42031	0.075	10.3	
		5x	MUL42051	0.13	9.3	
		10x	MUL40101	0.3	7.4	
		20x	MUL40201	0.4	4.7	
		50x	MUL40501	0.55	3.4	
明场	CF IC EPI Plan DI 用于双光束干涉测量平场	100x	MUL40900	0.7	2.0	
		CF IC EPI Plan Apo 平场复消色差	50x	MUT10051	0.95	0.4
			100x	MUT10101	0.95	0.3
150x	MUT10153	0.95	0.2			

尺寸

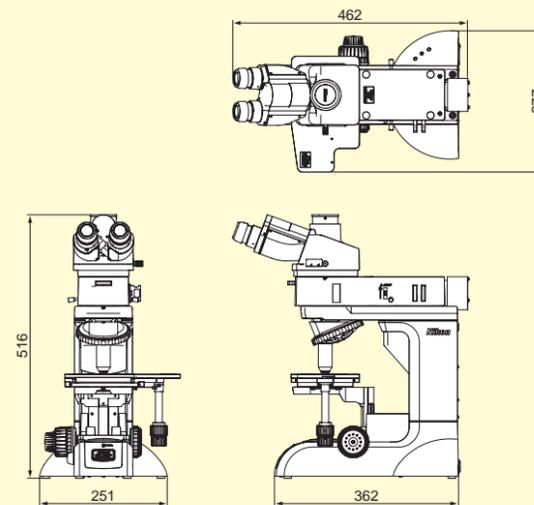
LV150N / LV150NA



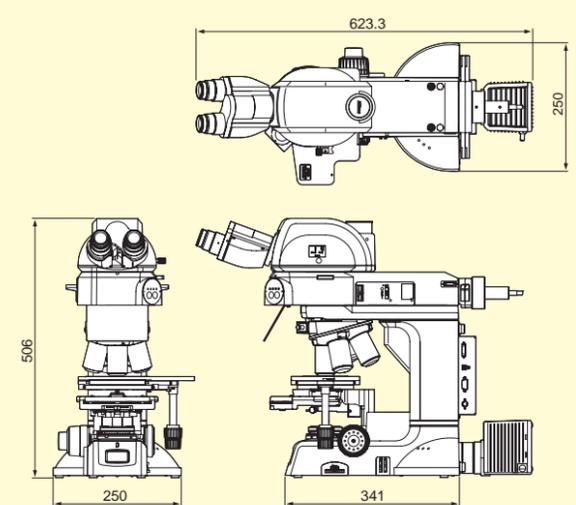
LV150NL



LV100ND

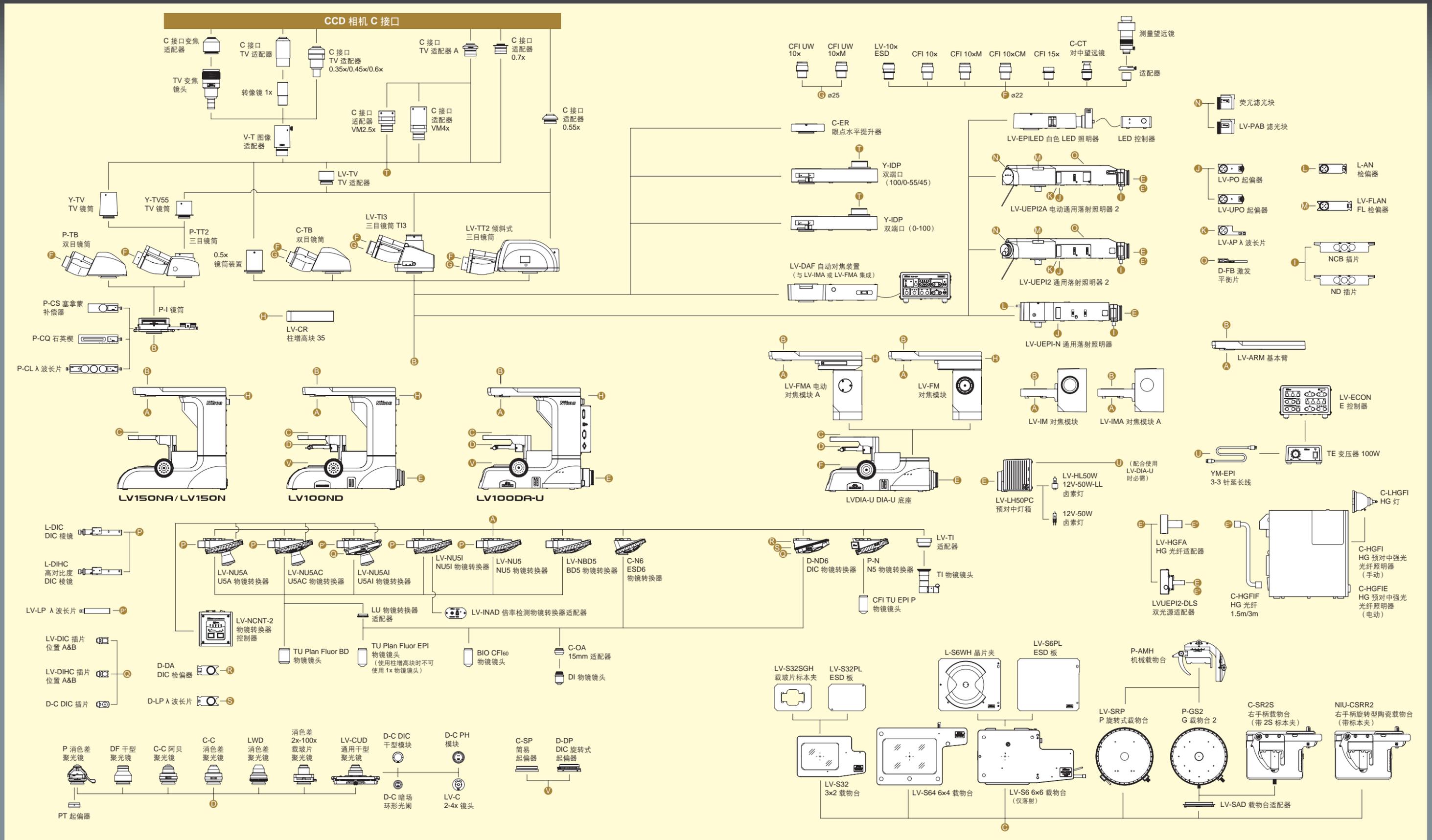


LV100DA-U



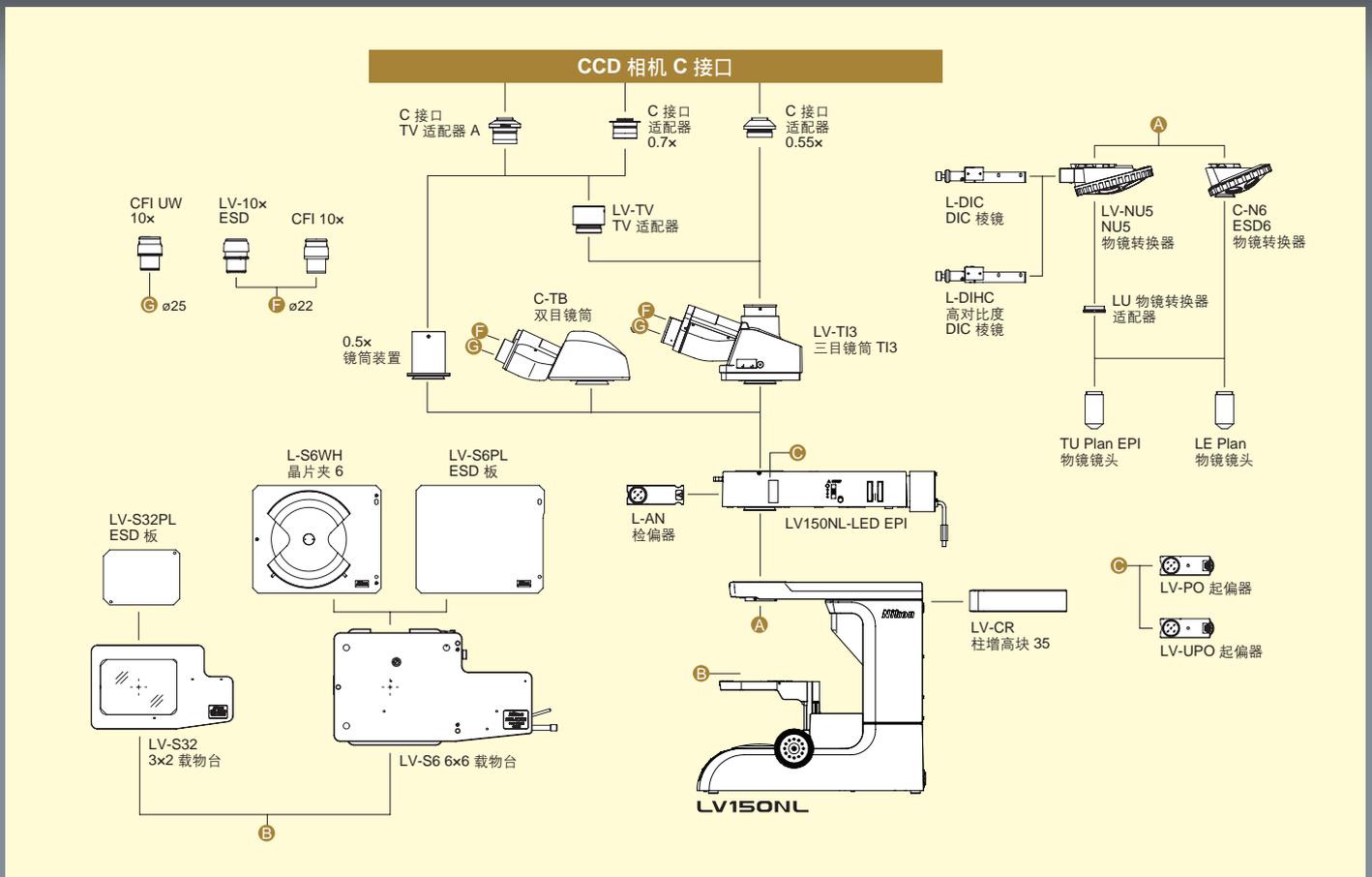
系统图解

用于 LV150N/LV150ND/LV100NDA/LV100DA-U



系统图解

用于 LV150NL



NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3,
Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290, Japan
Phone: +81-3-6433-3701 fax: +81-3-6433-3784
Industry.nikon.com

南京诺旭微光电有限公司
NanJing Nuoxu-v Opto-electronic CO.,LTD

电话: 025-85334943
传真: 025-85334943
邮箱: sales@nuoxu-v.cn
网址: www.nuoxu-v.cn

江苏省南京市栖霞区仙林大道 181 号万达茂 C 座 2006 室

免费咨询电话: 15301584943

